



△×				APPROVED	CHECKED	MATERIAL 材料	-	CHAMFER 一般面取	-	QUANTITY 個数					
△×				T. A.	T. A.	TREATMENT 処理	-	FINISHING 仕上	-	-					
△×						TREATMENT CONTACT 処理接点	-	DECENTRATION 偏芯	-						
△×				DESIGNED	DRAWN	OVER 250 UP TO 1000	±0.3	±0.5	±1.0	±0.2	UNIT (mm)	ANGLE 角度	METHOD 図法	REMARK 適用 (機種名)	
△× 1	Iris ring表記追加	19.03.03	T. F.			OVER 63 UP TO 250	±0.2	±0.3	±0.6	±0.15		-	VS-TCM04-100/S		
△× 2	C-Mount Unit デザイン変更 フィルター径追記	17.03.27	M. M.			OVER 16 UP TO 63	±0.1	±0.2	±0.4	±0.1		SCALE		1 / 1	NAME
NO.×箇所	REVISION 訂正事項	DATE	NAME			T. T.	S. K.	OVER 0 UP TO 16	±0.05	±0.1		±0.2	±0.1	SCALE	DATE
						TOLERANCES	A	B	C	S					